

用于溅射负离子源的透射表面电离器的研制

@王广甫@王文勋@董平\$北京师范大学分析测试中心

收稿日期 修回日期 网络版发布日期:

摘要 介绍了1种应用于表面电离型溅射负离子源的球面形透射表面电离器,并阐述了原理。这种电离器可使铯蒸气直接通过,避免了铯蒸气绕射造成电离表面铯原子通量低的缺点,增大了铯离子的产额,也使离子源的流强较采用非透射型电离器时提高了50%—87%。

关键词 [透射电离器](#) [表面电离](#) [铯离子产额](#) [透射电离率](#)

分类号

NEUTRON MULTIPLICATION CORRECTIONS FOR PLUTO NI UM SAMPLES MEASUREMENT AND MONTE CARLO CALCUL ATIONS

Abstract

Key words

DOI

通讯作者

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [\[PDF全文\]\(185KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“透射电离器”的 相关文章](#)

▶ [本文作者相关文章](#)